

**Judul:**

Indeks bias dan relasinya terhadap struktur ikatan lapisan tipis amorf silikon karbon (a-SiC:H) hasil deposisi metode dc sputtering

**Pengarang/Penulis:**

**Subjek:**

Opto-electronic properties ; Refractive index--Measurement--Technique

**Nomor Panggil:**

JURFIN 7:20 (2003)

**Penerbitan:**

**Link Terkait:**

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)